

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成31年3月14日 (2019.3.14)

【公開番号】特開2017-146136(P2017-146136A)

【公開日】平成29年8月24日 (2017.8.24)

【年通号数】公開・登録公報2017-032

【出願番号】特願2016-26700(P2016-26700)

【国際特許分類】

G 0 1 L 9/00 (2006.01)

G 0 1 L 19/14 (2006.01)

H 0 1 L 29/84 (2006.01)

【F I】

G 0 1 L 9/00 3 0 1 Z

G 0 1 L 19/14

H 0 1 L 29/84 A

H 0 1 L 29/84 B

H 0 1 L 29/84 Z

【手続補正書】

【提出日】平成31年1月30日 (2019.1.30)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

蓋状に形成されたセラミックス製のベースと、  
皿状に形成された受け部材と、  
前記ベース及び前記受け部材の間に挟まれたダイアフラムと、  
前記ベースにおける前記ダイアフラムの間に形成された受圧空間側に取り付けられた半  
導体型圧力検出装置と、

前記半導体型圧力検出装置に電氣的に接続されるとともに前記ベースを貫通する端子ピ  
ンと、

を備え、

前記ベースと前記端子ピンとの間に第 1 の口ウ付け部が形成されており、

前記ベースと前記ダイアフラムとの間に、リング部材がさらに挟み込まれており、

前記ベースと前記リング部材との間に第 2 の口ウ付け部が形成されている、

圧力検出ユニット。

【請求項 2】

前記受け部材と前記リング部材とは、両者間に前記ダイアフラムを挟み込んだ状態で溶  
接により一体化されている、

請求項 1 に記載の圧力検出ユニット。

【請求項 3】

前記ベースと前記第 1 の口ウ付け部との間にメタライズ層がさらに形成されている、

請求項 1 又は 2 に記載の圧力検出ユニット。

【請求項 4】

前記受圧空間に液状媒質が充填されている、

請求項 1 ～ 3 のいずれか 1 項に記載の圧力検出ユニット。

## 【請求項 5】

前記ベースと前記第 2 の口ウ付け部との間にメタライズ層がさらに形成されている、  
請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載の圧力検出ユニット。

## 【請求項 6】

請求項 1 ~ 5 のいずれか 1 項に記載の圧力検出ユニットと、前記圧力検出ユニットを外周側から包むように取り付けられるカバーと、一端が前記圧力検出ユニットの端子ピンに電氣的に接続されるとともに他端が前記カバーの外部に突出するリード線と、前記圧力検出ユニットの受け部材に取り付けられる流体流入管と、  
を備えた圧力センサ。

## 【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

上記目的を達成するために、本発明による圧力検出ユニットは、蓋状に形成されたセラミックス製のベースと、皿状に形成された受け部材と、前記ベース及び前記受け部材の間に挟まれたダイアフラムと、前記ベースにおける前記ダイアフラムの間に形成された受圧空間側に取り付けられた半導体型圧力検出装置と、前記半導体型圧力検出装置に電氣的に接続されるとともに前記ベースを貫通する端子ピンと、を備え、前記ベースと前記端子ピンとの間に第 1 の口ウ付け部が形成されており、前記ベースと前記ダイアフラムとの間に、リング部材がさらに挟み込まれており、前記ベースと前記リング部材との間に第 2 の口ウ付け部が形成されている。

## 【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

このとき、前記ベースと前記第 1 の口ウ付け部との間にメタライズ層がさらに形成されていてもよい。

## 【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

このとき、前記ベースと前記第 2 の口ウ付け部との間にメタライズ層がさらに形成されていてもよい。